

附录D

漆膜厚度检测测量过程
监视统计记录表

测量过程名称：漆膜厚度检测
被测参数：漆膜厚度
测量仪器：涂层测厚仪CM8820 测量范围：（0～2000）μm
监视方法：统计技术 核查标准：标准厚度片100 μm

序号	核查	观察记录（HB）					$\bar{X}$	R
	日期	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅		
1	2021.08.22	92.0	88.0	89.0	105.0	95.0	93.8	17.0
2	2021.09.02	95.0	96.0	98.0	112.0	106.0	101.4	17.0
3	2021.09.12	88.0	89.0	97.0	96.0	98.0	93.6	10.0
4	2021.09.22	99.0	96.0	102.0	98.0	96.0	98.2	6.0
5	2021.10.02	102.0	105.0	98.0	97.0	98.0	100.0	8.0
6	2021.10.12	96.0	97.0	102.0	103.0	104.0	100.4	8.0
7	2021.10.22	103.0	104.0	105.0	97.0	96.0	101.0	9.0
8	2021.11.02	98.0	102.0	103.0	98.0	102.0	100.6	5.0
9	2021.11.12	97.0	103.0	96.0	96.0	103.0	99.0	7.0
10	2021.11.22	95.0	98.0	105.0	103.0	99.0	100.0	10.0
11	2021.12.02	105.0	99.0	102.0	98.0	98.0	100.4	7.0
12	2021.12.12	96.0	95.0	98.0	102.0	100.0	98.2	7.0
$\bar{\bar{X}} =$ 98.93		$\bar{R} =$ 9.25						
查表得：		A ₂ = 0.577		D ₄ = 2.115		D ₃ = 0		

$\bar{\bar{X}}$ 控制图计算：
中心线 CL= $\bar{\bar{X}} =$ 98.9 μm
上控制线 UCL= $\bar{\bar{X}} + A_2 \bar{R} =$ 104.3 μm

漆膜厚度检测测量过程 监视统计记录表

下控制线 LCL= $\bar{\bar{X}} - A_2 \bar{R} = 93.6$ μm

R 控制图计算:

中心线 CL= $\bar{R} = 9.3$ μm

上控制线 UCL= $D_4 \bar{R} = 19.6$ μm

下控制线 LCL= $D_3 \bar{R} = 0$ μm

监视结果评价:

均值、极差控制图状态正常，漆膜厚度检测的测量过程中未出现非正常变异，能满足生产工艺要求。

核查人员: 史子姝

2021.12.12

审核人: 杨士华

2021.12.12